

540,003

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
22 juillet 2004 (22.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/061432 A2

- (51) Classification internationale des brevets⁷ : G01N 21/21 (72) Inventeur; et (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : HAZART, Jérôme [FR/FR]; 10, Place Saint-Bynard, F-38000 Grenoble (FR).
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2003/050211 (74) Mandataire : POULIN, Gérard; c/o Brevatome, 3 rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).
- (22) Date de dépôt international : 24 décembre 2003 (24.12.2003) (81) État désigné (national) : US.
- (25) Langue de dépôt : français (84) États désignés (régional) : brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
02/16847 30 décembre 2002 (30.12.2002) FR
03/50635 2 octobre 2003 (02.10.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33 rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).
- Publiée :
— sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport
- En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR THE OPTICAL CHARACTERIZATION OF MATERIALS WITHOUT USING A PHYSICAL MODEL

(54) Titre : PROCEDE DE CARCTERISATRION OPTIQUE DE MATERIAUX SANS UTILISATION DE MODELE PHYSIQUE

(57) ~~Abstract~~—A method for the characterization of materials without using a physical model. In order to characterize a layer of material in a space A of values assumed by a function $\alpha(\lambda)$ (λ : wavelength), (1) by reflectometry and/or ellipsometry on A, a measured spectrum Ψ is obtained, (2) m values $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ of α in A ($m \geq 1$) are chosen, with $B = \{ \alpha \text{ such as } \min(\alpha_i) = \alpha \leq \max(\alpha_i) \}$ for $m > 1$, and $B = A$ si $m = 1$, (3) m complex index values n_{+jk} to m α_i are chosen, (4) if $m \neq 1$ the index n (A) on B is calculated by interpolation, on the basis of $(\alpha_i, n_i = n(\alpha_i))$, $1 \leq i \leq m$, and if $m = 1$, $n(\alpha) = n_1(\alpha_1)$ on B, (5) M parameters $M = 2m + 1$ are chosen, in addition to an error function E_r and by minimization of E_r to M parameters, (a) with the aid of the law of interpolation of (α_i, n_i) on B, n (α), $\alpha \in B$, (b) is deduced with the aid of n (α) and the thickness e of the layer, a theoretical spectrum $\Psi(n(\alpha), e)$ is calculated, (c) Ψ and Ψ are compared with the aid of E_r and, if $E_r(\Psi, \Psi)$ is e or minimal, it is possible to move on to (α, e) , if not (d) M parameters are varied in order to tend towards the minimum of $E_r(\alpha, e)$ and it is possible to move on to (a), (e) if $E_r(\alpha, e) < e$, the index is equal to the latter thus obtained, if not m is increased and it is possible to move onto (2).

(57) Abrégé : Procédé de caractérisation optique de matériaux sans utilisation de modèle physique. Pour caractériser une couche d'un matériau dans un intervalle A de valeurs prises par une fonction $\alpha(\lambda)$ (λ : longueur d'onde), (1) par réflectométrie et/ou ellipsométrie sur A on obtient un spectre mesuré Ψ , (2) on choisit m valeurs $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ de α dans A ($m \geq 1$), avec $B = \{ \alpha \text{ tels que } \min(\alpha_i) \leq \alpha \leq \max(\alpha_i) \}$ pour $m > 1$, et $B = A$ si $m = 1$, (3) on choisit m valeurs d'indice complexe n_{+jk} aux m α_i , (4) si $m \neq 1$ on calcule par interpolation l'indice n (α) sur B, à partir des $(\alpha_i, n_i = n(\alpha_i))$, $1 \leq i \leq m$, et si $m = 1$, $n(\alpha) = n_1(\alpha_1)$ sur B, (5) on choisit M paramètres, $M \leq 2m + 1$, et une fonction d'erreur E_r et par une minimisation de E_r à M paramètres, (a) à l'aide de la loi d'interpolation des (α_i, n_i) sur B, on déduit n (α), $\alpha \in B$, (b) à l'aide de n (α) et de l'épaisseur e de la couche, on calcule un spectre théorique $\Psi(n(\alpha), e)$, (c) on compare Ψ et Ψ à l'aide de E_r et, si $E_r(\Psi, \Psi)$ est S e ou minimal, on passe à (e), sinon (d) on fait varier les M paramètres pour tendre vers le minimum de $E_r(\Psi, \Psi)$ et on va à (a), (e) si $E_r(\Psi, \Psi) < e$, l'indice est pris égal à celui obtenu en dernier, sinon on augmente m et on va à (2).

WO 2004/061432 A2